熱処理機器のご案内

Vol.30

Guide to Heat Treatment Equipment

赤外線ランプから放射された赤外線をゴールド回転楕円ミラーで集光し、試料に照射・昇温させます

Collects infrared rays emitted from an infrared lamp by a gold spheroid mirror and irradiates the sample material to raise its temperature.



赤外線導入加熱装置 GVL298N





お手持ちの真空装置に取付可能。周りを加熱せず試料のみを加熱

Can be attached to your equipment. Heating only the sample without its surroundings.

GVL298

1500℃

150℃/S

10-7Pa

高速昇温型

High-speed heating model

■ 1500℃まで約1分 One minute to attain 1500℃

GVH298

1400°C

1°C/S

10⁻⁹Pa

超高真空型

Ultra High-vacuum model

■ 10⁻⁹ Pa の超真空中での加熱が可能

Attainable vacuum degree: 5 × 10-9 Pa



X線光電子分光装置XPS取付例

(写真: 名城大学様ご提供)

真空/酸化雰囲気中 の加熱に!

Support heating in a vacuum or an oxidizing atmosphere!



GVL298N

超高温スーパーRTA装置 Ultra High Temperature Super RTA System

MAX1800℃まで1分以内で加熱 グラフェン、SiC 等の高速加熱処理に最適

Can heat up to a MAX, temperature of 1800°C in less then 1min. Ideal for high-speed treatment such as graphene, SiC.

SR1800G

1800°C

300°C/S

10-3Pa

卓上型

Desk top

SR1800

1800℃

300°C/S

10⁻⁵Pa

高真空型 High vacuum

> 超高速! 超高温!

Ultra high speed! Ultra high temperature!



SR1800G

卓上型(赤外線放射部、試料室、温度制御部を一体化) 真空、ガス混合雰囲気にも対応

Integrated Desktop (Infrared radiation and a sample room temp controller all in one unit) Applicable to a vacuum or gas atmosphere.

IVF298W

1500℃

100°C/S

10-4Pa

ガスフロー

IVF298CV

1700℃

150℃/S

10⁻⁴Pa

ガスフロ-

■ 真空チャンバーに8ヶ所のポート有り ブロック状、粉体状の試料も加熱可能

8 ports in vacuum chamber

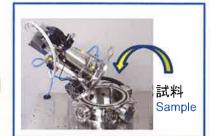
The heating of blocks or powdered samples are possible

対面照射!

Twin-beam irradiation!



Easy and quick handling of a sample!







大気用 赤外線導入加熱装置

Infrared Guide Heating Systems for Atmospheric Condition

GA298

1500°C

赤外線放射加熱器 Infrared radiation heater

1500℃

IR298

加熱!

お手軽

Easy and quick heating





【アイコンの説明】

最高到達温度(例:1800℃) Max. attainable temperature

最大昇温速度(例:150℃/S) Max. heating rate

最高到達真空度 Max. attainable vacuum degree

ガスフロー加熱 ガスフロー Gas flow heating GFA430VN

1000℃

10-4Pa

ガスフロー

熱源にインコネルヒーターを使用。炉長の70%で均温を実現

Uses inconel heaters as a heat source.

Uniform temperature for 70% of the length of the furnace. (Shown in gold in the picture.)

- 均温特性:1000℃±5℃ Uniform temperature characteristics
- 昇温速度(室温→1000℃)約30分 Room temperature to 1000°C in approx.30min
- ▶ 降温速度(1000℃→200℃) 自然冷却 約60分/強制冷却 約30分 Approx.60 min in natural cooling Approx.30 min in forced air cooling
- 大型炉、超高真空型にも対応(特注) Applicable to a large size furnace or an ultra-high vacuum type(Special order)



周辺機器

Peripheral Equipment

温度制御器 TP920RF Temperature TP920VT controller

TP920FF

TP920CE



● 定値温度制御器

DP500

Constant value Temperature controller



過昇温防止機構

HS₂

Overheating prevention mechanism



Infrared thermal sensor

ITS4



▶ 移動式温度センサー Movable thermal sensor

RS250V

PK361

KS250V



真空用温度センサー

Vacuum thermal sensor



高真空排気装置 High vacuum exhauster



HC80V

● 全圧型真空計

All pressure vacuum gauge



フロースイッチ

DFS3R

Flow switch





株式会社サーモ理工

TEL 0422-76-2511 FAX 0422-76-2514 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 8-7-3 三鷹ハイテクセンター THERMO RIKO CO.,LTD.

E-mail: sekigai@thermo-r.co.jp https://www.thermo-r.co.jp/ Phone: +81-422-76-2511 Fax: +81-422-76-2514

代理店·販売店 Agent/Dealer

製品改良などにより仕様外観等を予告なしに変更する場合もありますのでご了承下さい。 We reserve the right to modify the specifications, appearance, and other features of the products described herein at any time and without prior notice (2020,8,500)